

Abstract

基板保持装置、基板研磨装置、弾性部材および基板保持装置の製造方法

トップリング本体と、前記トップリング本体との間に複数のエリアを形成する第1面と、前記第1面とは反対側にあつて基板を保持可能な第2面と、を有する弾性膜と、前記複数のエリアのうちの第1エリアに連通し、前記第1エリアを加圧することが可能な第1ラインと、前記第1エリアに連通し、前記第1エリアから排気することが可能な第2ラインと、前記第1エリアの流量に基づいて測定値が変化する測定器と、前記複数のエリアのうちの前記第1エリアとは異なる第2エリアに連通し、前記第2エリアを減圧することが可能な第3ラインと、前記第1ラインと前記第2ラインとの間において、前記弾性膜の第2面が基板を保持していない場合には前記弾性膜の第1面と離間しており、前記弾性膜の第2面が基板を保持した場合には前記弾性膜の第1面と接触するように設けられた弾性部材と、を備える基板保持装置が提供される。

Figure 6A